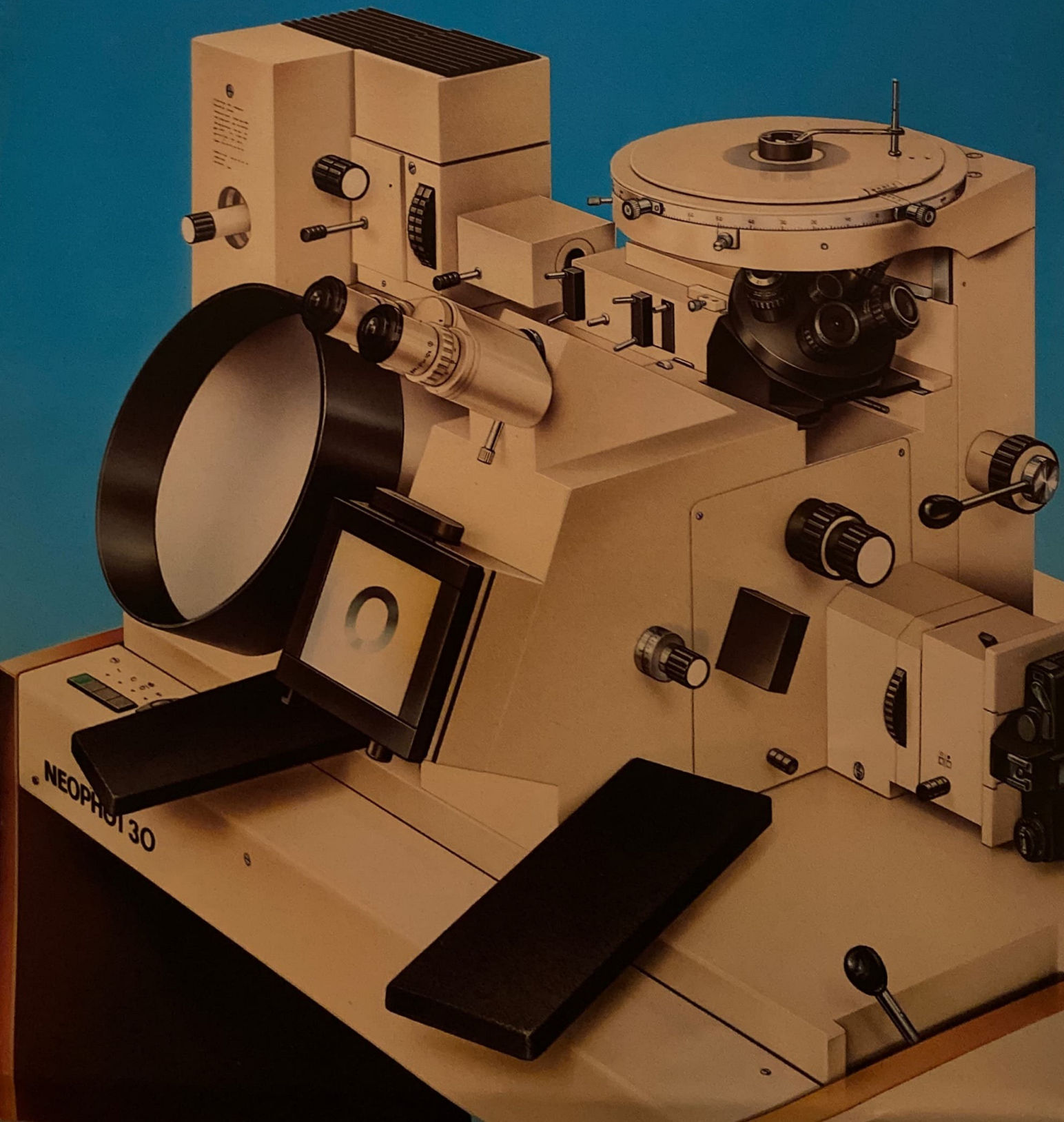
CARL ZEISS JENA

ZEISS NEOPHOT 30

Großes Auflicht–Kamera–mikroskop



ZEISS NEOPHOT 30

Auflichtmikroskop umgekehrter Bauart für Forschung und Routine

Hervorragende optische Abbildungsgüte, rationelle und hochproduktive Arbeitsweise, ein ergonomisch günstiges Gerätedesign und weitgefächerte Einsatzmöglichkeiten sind Kennzeichen der neuen Mikroskopgeneration des seit Jahrzehnten bewährten NEOPHOT-Typs.

Jena – Mikroskope 250 – CF

CF-Geräteoptik mit hoher Abbildungsgüte
Neue CF-Großfeld-HD-Planachromate/Planapochromate für effektive Zwischenbilddurchmesser bis 32 mm
Vergrößerungsbereich 10× ... 2000×
Bereich einstellbarer Abbildungsmaßstäbe 6,3 : 1 ... 2000 : 1
Vergrößerungswechsel mit Faktoren 0,8×; 1,0×; 1,25×; 1,6×; 2,0×.
Lupenmikroskopische Einrichtung für Vergrößerungen 1,6× ... 8× und Abbildungsmaßstäbe zwischen 1 : 1 und 8 : 1
Projektivwechsel in den Kamerastrahlengängen
Projektionsschirm 250 mm ∅ mit Fresnellinse

Anwendbarkeit aller wesentlichen mikroskopischen Beleuchtungs-, Beobachtungs- und Untersuchungsverfahren
Hell- und Dunkelfeldbeleuchtung
Schiefe Beleuchtung
Orientierende und quantitative polarisationsoptische Untersuchungen
Interferenzkontrast (NOMARSKI)
Mikrofotografie in den Aufnahmeformaten 24 mm × 36 mm; 6,5 cm × 9 cm; 3¼″ × 4¼″; 9 cm × 12 cm; 4″ × 5″; 8″ × 10″.
Mikroeindruck-Härteprüfung (VICKERS)
Projektion auf Bildfläche 250 mm ∅
Messen, Zählen, Vergleichen
Bildübertragung und -analyse mit handelsüblichen Videoeinrichtungen
Hochtemperaturmikroskopie
Objektmarkierung

Hoher Bedienkomfort gewährleistet rationelle und hochproduktive Arbeitsweise
Objektivwechsel mit Objektivrevolver
Strahlengangumschalter für sekundenschnellen Wechsel zwischen subjektivem Einblick, Projektion und beiden Kameraausgängen
Modulbauweise für schnellen Verfahrenswechsel
Belichtungsautomatik nach neuem Konzept für höchste mikrofotografische Ansprüche
Belichtungsautomatik in beiden Kamerastrahlengängen wirksam
Aufsuchen und Scharfstellen des Bildes im binokularen Einblick des Mikroskops
Messen, Zählen und Vergleichen mit binokularem Einblick

Ergonomisch günstiges Gerätedesign ermöglicht ermüdungsarmes Arbeiten
Bedienelemente in Handreichweite des Mikroskopierenden
Einblickwinkel 30°
Einstellbare Auflagen zum Aufstützen der Arme beim Mikroskopieren
Griffgünstige Anordnung von Bau- und Zusatzeinheiten im Zubehörschrank

NEOPHOT 30 – Anwendungsbereiche Werkstoffwissenschaften
Grundlagenforschung
Metallographie, Plastographie und Keramographie bei Entwicklung neuer und Verbesserung bekannter Werkstoffe

Betriebskontrolle
Kontrolle von Roh- und Grundstoffen
Festlegung von Qualitätsmerkmalen und Qualitätskontrolle bei Herstellung und vor Verarbeitung von Werkstoffen

Erzmikroskopie
Lagerstättenforschung
Analyse verhüttungsfähiger Minerale

Ausbildung
Nutzung der multivalenten Einsetzbarkeit für Lehre und Forschung an Hoch- und Fachschulen

Zusatzausrüstungen für NEOPHOT 30
Einrichtung für Interferenzkontrast (NOMARSKI)
Einrichtung für quantitative polarisationsoptische Untersuchungen
Mikroeindruck-Härteprüfer mhp 100
Kreuztisch 50 mm × 50 mm
Baueinheiten der Mikrofotografischen Einrichtung mf-AKS
Lupenmikroskopische Einrichtung
TV-Anpassung
Kameraansatz 8″ × 10″
Großfeld-HI-Planachromate
LD-Objektive
Stellbare und Brillenträgerokulare
Gefügevergleichsokular
Interferenzfilter-Monochromator
Meßschraubentubus P 16×
Binokulare Meßeinrichtung
Meß- und Zählfolien zur Projektionsscheibe 250 mm ∅
Zweitbeobachtertubus/Objektmarkierer
Elektrisches Integriergerät ELTINOR
Anpassung für Schnellregel-Heizkammer VACUTHERM

CARL ZEISS JENA
Kombinat
VEB Carl Zeiss JENA
Deutsche Demokratische Republik
DDR 6900 Jena, Carl-Zeiss-Str.1
Telefon: 830, Telex: 5886122

Ag. 29/013/85

Druckschriften-Nr. 30-681-1